NIMS微細加工共用設備 利用料金表(内部利用)

※2025年4月1日更新

	F4月1日更新	NIMS利用者 データ提供あり 及び データ提供非対応 (NIMS所属かつNIMS予算での支出に限る)			(税抜表示) NIMS利用者 データ提供なし (NIMS所属かつNIMS予算での 支出に限る)
No.	装置リスト	機器利用	技術補助	技術代行	機器利用
1	電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	¥11,000	¥14,200	¥17,400	¥16,500
2	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥6,600	¥9,800	¥13,000	
3	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	
4	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	
5	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	
6	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	
7	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	
8	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
9	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	<u> </u>
10	蒸気二流体洗浄装置 [SSM101]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	<u> </u>
11	スパッタ装置 [JSP-8000] スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥2,200 ¥2,200	¥5,400	¥8,600	
13	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥2,200	¥5,400 ¥5,400	¥8,600 ¥8,600	<u>`</u>
14	スパック装置 [CFS-4EP-LL #4]		¥5,400	·	
15	スパック表直 [CFS-4EP-LL #4] 電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥2,200 ¥2,200	¥5,400	·	
16	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
17	電子銃型蒸着装置 [ADS-E810]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	
18	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	
19	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	
20	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥2,200	¥5,400	·	
21	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥2,200	¥5,400		<u>·</u>
22	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	
23	ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	
24	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥4,400	¥7,600	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
25	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	
26	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	
27	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]		¥5,400	¥8,600	
28		¥4,400	¥7,600		
29	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #2]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
30	イオンビームミリング複合装置 [16IBE]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
31	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
32	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
33	FE-SEM [S-4800]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
34	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
35	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
36	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
37	FE-SEM+EDX [JSM-IT800]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
38	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
39	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
40*	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
41*	触針式プロファイラー [Dektak XT-A #1]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
42*	触針式プロファイラー [Dektak XT-A #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
43*	エリプソメーター [MARY-102FM]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
44*	分光エリプソメーター [M2000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
45*	分光エリプソメーター [UNECS-2000A]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
46*	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
47*	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
48*	ダイシングソー [DAD322]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
49*	ダイシングソー [DAD3220]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
50*	室温プローバー [MX-200/B]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
51*	ワイヤーボンダー [7476D #1]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
52*	ワイヤーボンダー [7476D #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
53*	ウェットステーション	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
54*	CAD作成システム	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
54		•			

考』 1, 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価(税抜)であり、これに利用時間(※)を乗じます。

^{2,15}分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。

^{3,「}機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。

^{4, 「}技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。 5, 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。

^{6,「}技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。

[※] 利用時間は、装置予約時間(=装置占有時間:装置の立ち上げ/終了作業時間含む)です。